

GETOGETHER

Dec.12, 17:00-18:00 @ 日比谷マツモトロー (北コンコース1階)

～ STS 先端リソグラフィ & フォトマスク & 計測・検査編 ～

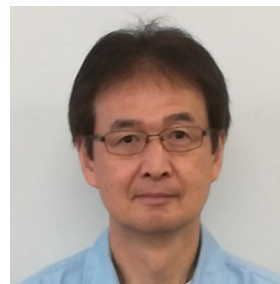
どなたでも ご参加いただけます
セッション担当委員も会場にてお待ちしております



エーエスエムエル
・ジャパン
永原 誠司



キヤノン
酒井 啓太



大日本印刷
須向 一行



日立ハイテク
堀田 尚二



HOYA
紐持 大介



ニコン
青山 肇



オントウ・イノベー
ション・ジャパン
中村 肇



テクセンド
フォトマスク
小西 敏雄



東京エレクトロン
浅野 昌史

STS計測・検査セッション終了後に開催するネットワーキングパーティーです。

ドリンク・軽食をお楽しみながら、講演者や参加者の皆さま、関連ご出展企業との交流を深めて頂けます。

GETOGETHERのみご参加の場合は、17:00頃になりましたら直接会場までお越しください。

*入場の為に、事前登録は不要ですが、[SEMICON Japan 来場バッジ](#)が必要です。

<関連セッションのご案内>

12/12
Thu.

9:30-11:30 **STS フォトマスク セッション** ー半導体製造を支えるフォトマスクの現状と最新技術動向ー
[講演者] テクセンドフォトマスク 小嶋 洋介氏 HOYA 笑喜 勉氏 レーザーテック 宮井 博基氏

12/12
Thu.

12:00-14:00 **STS 先端リソグラフィ セッション** ー微細化への探求 (EUVL/NIL) とデバイス3D化に対応する最新露光技術ー
[講演者] ASML Japan 永原 誠司氏 Micron Memory Japan 吉野 宏氏 Canon 森 堅一郎氏 Nikon 田中 さゆり氏

12/12
Thu.

14:30-16:30 **STS 計測・検査セッション** - Metrology & Inspection : 先端デバイス向けパターン形状計測・異物検査などの最新動向 -
[講演者] Rapidus 渡邊 健二氏 Onto Innovation Mike Rosa氏 リガク 表 和彦氏

スピードネットワーキング参加大募集!

企業紹介ショートプレゼンをしませんか。ご希望の方は、当日会場まで直接お越しいただき、スタッフへお声かけください。

時間：1社あたり5分以内

内容：自社紹介、半導体関連サービスおよび製品技術の説明など存分にアピールしてください